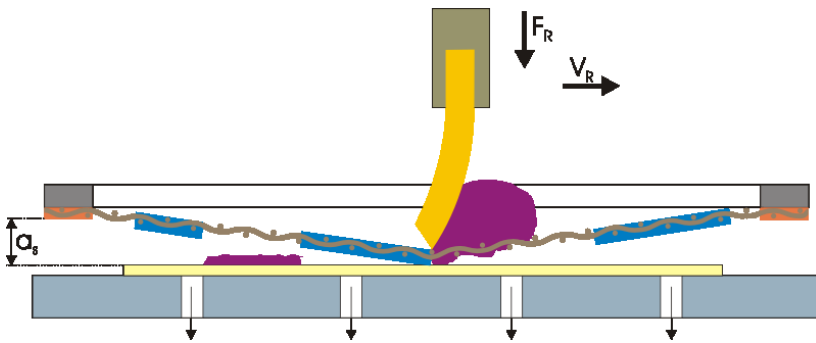
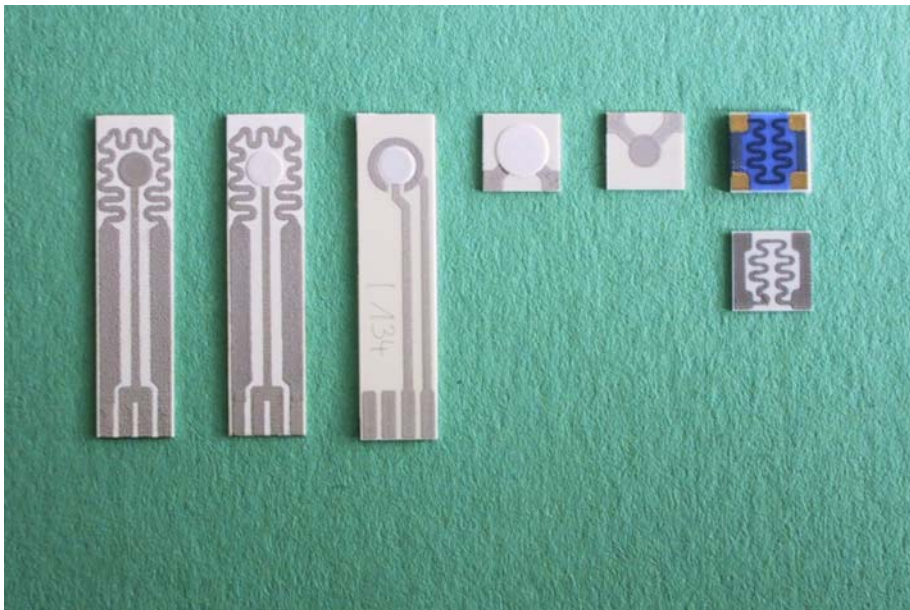


## Dickschichttechnik zur Sensorpräparation



Beim Druckvorgang wird die Paste mit der Rakel durch das Sieb gepresst. Dieser Vorgang erzeugt ein Druckbild auf dem Substrat, das die gleichen Konturen wie die offene Siebfläche zeigt.

Hinter der Rakel springt das Sieb bedingt durch die Siebspannung sofort wieder ab und die Paste haftet auf dem Substrat.



Beheizte Sauerstoffsensoren auf Festelektrolytbasis



**Labor für Siebdrucktechnik**

### **Halbautomatischer Siebdrucker EKRA mat S30**

- Siebgröße Typ 6: (450 mm x 350 mm)
- bis 35 mm Druckguthöhe
- Rakelgeschwindigkeit, Rakeldruck und Absprung zentral einstellbar
  
- hohe Flexibilität bei der Wahl der Schichten und bei Technologievariationen
- gute mechanische und elektrochemische Stabilität der Schichten
- Betriebstemperaturbereich bis 1200 °C
- Eignung für die Herstellung von Teststrukturen für die Forschung und die Sensorherstellung

### **Entwicklungen und Applikationen im Kurt-Schwabe-Institut Meinsberg**

- Pulver- und Pastenpräparation, Pastencharakterisierung
  
- sensorische Grundstrukturen für Biosensoren, potentiometrische Sensoren
- amperometrische Sensorstrukturen  
(Dreielektrodenanordnungen mit Pt- und Au-Elektroden)
- planare Leitfähigkeitsmesszellen
- amperometrische und potentiometrische Sensorstrukturen auf Festelektrolytbasis
- Heizerstrukturen bis 750 °C Arbeitstemperaturen